

レジストパラメータ受託測定条件表

2008.7.1
リソテックジャパン(株)

レジスト名	種類	露光波長	目標膜厚(nm)	Spin (rpm)	Eth (mJ/cm ²)	PAB		PEB		屈折率n		
						温度(°C)	時間(s)	温度(°C)	時間(s)	at 633nm	n	k
ABC(例)	CA	248	350	2500	50	90	90	110	90	1.56	1.589	0.024
BARC			80									

現像液	現像時間	現像温度

BARC	あり・なし
HMDS	あり・なし

溶媒	希釈
	あり・なし

特記事項

測定を希望するパラメータに○を付けて下さい。

現像パラメータ	測定の有無
Mackモデル	○・×
拡張Mackモデル	○・×
Notchモデル	○・×

表面難溶化パラメータ	測定の有無
Surface Development Rate	○・×
Inhibition Depth (nm)	

PABパラメータ	測定の有無
Thermal Decomp. Ea(kcal/mole)	○・×
Thermal Decomp. Ln(Ar) (1/s)	

酸拡散パラメータ	測定の有無
PEB Diffusivity Ea (kcal/mole)	○・×
PEB Diffusivity Ln(Ar) (nm ² /s)	

脱保護反応次数	測定の有無
Amplification Reaction Order	○・×

クエンチャー定数	測定の有無
Relative Quencher Concentration	○・×

脱保護パラメータ	測定の有無
PEB Amplification Ea (kcal/mole)	○・×
PEB Amplification Ln(Ar) (1/s)	
PEB Diffusion-Controlled Reaction Ea (kcal/mole)	
PEB Diffusion-Controlled Reaction Ln(Ar) (1/nm ²)	

酸失活パラメータ	測定の有無
PEB Bulk Acid Loss Ea (kcal/mole)	○・×
PEB Bulk Acid Loss Ln(Ar) (1/s)	

	測定の有無
A・Bパラメータ	○・×
Cパラメータ	○・×

パラメータの最適化作業	測定の有無
	○・×

下記のパラメータは実測できません。

Room Temperature Acid Diff. Length

PEB Acid Evaporation Ea (kcal/mole)

PEB Acid Evaporation Ln(Ar) (1/s)

Unexposed n Completely Exposed n